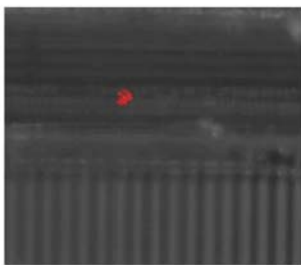


微光顯微鏡及鐳射掃描系統

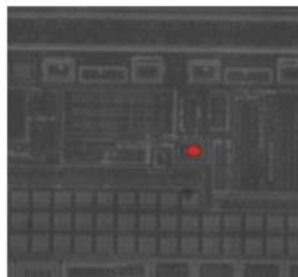


微光顯微鏡(EMMI)系統利用其高靈敏度的短波紅外線 InGaAs 鏡頭，可探測到半導體元件內電子結合發生時發射的 $0.9 - 1.6\mu\text{m}$ 波長的微弱光線信號，是一種相當有用且效率極高的半導體分析工具。此系統還配備先進的鐳射掃描系統(LSM)，以 OBIRCH 方法，測出晶片內短路位置。

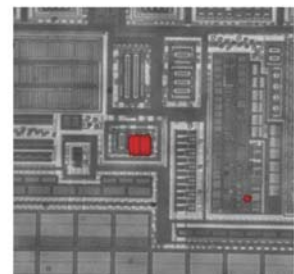
伴隨的鐳射掃描模組，可以執行 OBIRCH，OBIC 和 SEI，用以檢查晶片前端和背面的短路，開路及污染物情況。



HYPER LENS



5X LENS



20X LENS

